

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002年8月8日 (08.08.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/061439 A1

(51) 国際特許分類: G01R 1/067, H01L 21/66

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/00444

(22) 国際出願日: 2002年1月22日 (22.01.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-19471 2001年1月29日 (29.01.2001) JP
特願2001-136192 2001年5月7日 (07.05.2001) JP
特願2001-237540 2001年8月6日 (06.08.2001) JP
特願2001-357763 2001年11月22日 (22.11.2001) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 住友電気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 Osaka (JP).

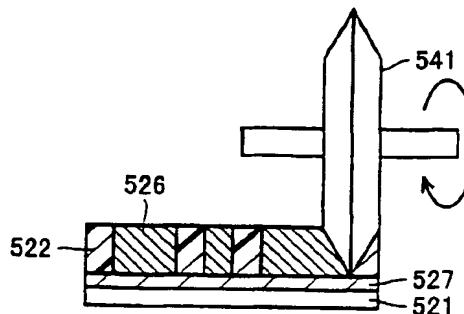
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 平田嘉裕 (HIRATA, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目12番1号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 羽賀剛 (HAGA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目12番1号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP).

(81) 指定国(国内): CN, KR, US.

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(54) Title: CONTACT PROBE, METHOD OF MANUFACTURING THE CONTACT PROBE, AND DEVICE AND METHOD FOR INSPECTION

(54) 発明の名称: コンタクトプローブおよびその製造方法ならびに検査装置および検査方法



(57) Abstract: A method of manufacturing a contact probe, comprising an electroforming process for forming a metal layer (526) by performing an electroforming so as to fill clearances in a resist film (522) by using the resist film (522) as a pattern frame having a shape matching the contact probe disposed on a substrate (521), a tip working process for sharpening the area of the metal layer (526) forming the tip end part of the contact probe by diagonally cutting out the area, and a retrieval process for retrieving only the metal layer (526) from the pattern frame.

WO 02/061439 A1

(続葉有)